www.www.www.WEST

Generate Collection

L11: Entry 3 of 3

File: JPAB

Dec 18, 1998

PUB-NO: JP410335966A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP <u>10335966</u> A TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUBN-DATE: December 18, 1998

INVENTOR - INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKAGI, MICHIAKI YAMAZAKI, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

APPL-NO: JP09140673 APPL-DATE: May 29, 1997

INT-CL (IPC): H03 H 9/145; H03 H 9/25

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make a device small in size and improved in performance by setting an electrode finger cyclic length such that it around the center of plural interdigital electrodes it constitute a resonator having a specific conductor width as to have different values from electrode finger cyclic length on both sides.

SOLUTION: Interdigital electrodes (IDT) are formed by alternately and arranging in parallel electrode fingers 103 and 104 of positive and negative polarities on positive and negative supply conductors 101 and 102 with them crossed in the phase propagation direction of an surface acoustic wave on a piezoelectric substrate 100. The conductor width of the fingers 103 and 104 is set to almost 1/4 wavelength λ, and also an electrode finger cyclic length PTc which is near the center and electrode finger cyclic length PTs on both sides have different values. That is, when the propagation coefficient of a surface acoustic wave caused by the substrate 100 and the IDT is negative, it is of a frequency- increasing type that meets a condition PTcPTs. Further, the electrode finger cyclic length PT has gradual changes according to an X coordinate position through prescribed rules.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

HO3H 9/145

9/25

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-335966

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.6

識別配号

FΙ

H03H 9/145

Z

9/25

Z

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-140673

平成9年(1997)5月29日

(71)出願人 000002369

セイコーエブソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 髙木 道明

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 山崎 隆

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

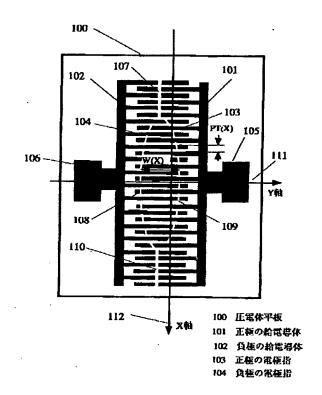
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 弹性表面波装置

(57)【要約】

【課題】本発明は、IDTのみで構成したIDT型SA W共振子のQ値向上とスプリアスを抑圧し、これを用い て小型で性能がよ良い、横および縦多重モードフィルタ 等を実現する。

【解決手段】IDTを複数に分割したうえに、各分割さ れたIDTの電極指周期長を使用する圧電基板の性質 が、周波数上昇型か周波数降下型かに対応して周波数ポ テンシャルを共振子の振動エネルギが中央に集中して閉 じ込められる様に設定することにより、従来なく小型で 性能のすぐれた I D T型共振子と、これを用いて横及び 縦多重モード型の共振子型フィルタを実現できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電体平板上に、弾性表面波の位相伝搬 方向に直交して正と負の極性の金属導体を交互に平行配 置してなるすだれ状電極を形成し共振子として使用する 弾性表面波装置において、

前記すだれ状電極の電極指の導体幅は、利用する弾性表 面波の波長入のほぼ4分の1となし、

前記すだれ状電極は、少なくとも3つ以上の領域に区分されて、かつ中央付近の前記電極指の周期長PTcが両側の領域の前記電極指周期長PTsに対して異なる値を有することを特徴とする弾性表面波装置。

【請求項2】 前記中央付近の電極指周期長をPTc、両側の電極指周期長をPTsとした場合に、前記圧電体基板と前記すだれ状電極による弾性表面波の伝搬に係わる分散関係を代表する係数aが負の場合においては、PTc<PTsの条件を満たす周波数上昇型とし、前記係数aが正の場合には、PTc>PTsの条件を満たす周波数降下型としたことを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置。

【請求項3】 前記すだれ状電極はM対の正負電極指を 20 持ち、電極指の交差幅が中央で1の値をとるWF(X) = COS(KX)の重み付けを有しており、かつKの値を、0.5< ξ <0.9として、 ξ <0.9として、 ξ <0.9として、 ξ <0.0至極指の交差幅が中央で1の値を取るWF(X) = COS(ξ <0.9として、 ξ 0.9として、 ξ

【請求項5】 前記PTsと前記PTcの比PTs/PTcを1以上から、ほぼ前記すだれ状電極を反射器と見なした場合の反射中心周波数 f_{R0} とアドミタンスの最大値 f_{T0} の周波数の比 f_{R0}/f_{T0} の範囲としたことを特徴とする請求項2記載の弾性表面波装置。

【請求項6】 前記PTcと前記PTsの比PTc/PTsを1以上から、ほぼ前記すだれ状電極を反射器と見なした場合の反射中心周波数fRoとアドミタンスの最大値の周波数fToの比fTo/fRoの範囲としたことを特徴とする請求項2記載の弾性表面波装置。

【請求項7】 前記圧電体平板が128°YカットX伝搬であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を0.5から2%の範囲とし、PTs/PTc=1から1.02としたことを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置。

 から0.85としたことを特徴とする請求項1記載の弾 性表面波装置。

【請求項9】 前記圧電体平板が128° YカットX伝搬であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を3から3.5%の範囲とし、前記PTcと前記PTsの比をほぼ等しく設定してフィルタ機能用途としたことを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置。

【請求項10】 前記すだれ状電極の電極指の対数Mが 50から250対としたことを特徴とする請求項8記載 の弾性表面波装置。

【請求項11】 前記圧電体平板が水晶であり、 前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/ 入を2から5%の範囲とし、PTs/PTc=1.00 7から1.02としたことを特徴とする請求項1記載の 弾性表面波装置。

【請求項12】 前記すだれ状電極の電極指の対数Mが 100から300対としたことを特徴とする請求項11 記載の弾性表面波装置。

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は弾性表面波を利用して構成される共振子および共振子型フィルタ、さらにはトランスバーサル型フィルタ等の分野において、サイズの小型化を実現した弾性表面波装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の弾性表面波装置における第1の種類として、共振子および共振子型フィルタ等が知られている。これらは、少なくとも1つのすだれ状電極(以降省略してIDTと称す)と、少なくとも1対の反射器からなる(特公平7-73177号公報,特公平4-52005号公報参照のこと)。また特開昭58-12418号公報には、前記IDTのみの共振子とこれを組み合わせた横多重モードフィルタの例が開示されている。さらにまた、特開平6-85602号公報には、IDTのみの構成からなるIDT型共振子の例が挙げられている。

【0003】また弾性表面波装置の第2の種類として、 2重分割電極(8分の1波長電極のこと)からなるID Tを用いたトランスパーサル型のフィルタ等がある(特 公平2-45368号公報)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし前述の第1の種類に属する従来技術である特公平7-73177号公報、特公平4-52005号公報の場合には、反射器を使用する分だけ共振子,共振子型フィルタにおける弾性表面波の伝搬方向の寸法が長くなり、近年著しい発展を見せているGSM方式とかPHS方式の携帯電話に用いられる中間周波フィルタ(IFフィルタ)に要求される 素子の小型化ができないという課題があり、また従来の

2

10

20

3

特開昭58-12418号公報および特開平6-856 02号公報に示されたいわゆるIDT共振子の技術では、共振子のQ値(共振先鋭度を示す数値)が数千と小さく、十分に小さな等価直列抵抗値が得られず、フィルタの挿入損失が大きくなるという欠点があった。

【0005】また、トランスバーサル型のフィルタ(特公平2-45368号公報)等の前述の第2の種類に属する従来技術では、8分の1波長の電極指を用いているために、素子の周波数が400MHzと高くなった場合に、おおむね電極指幅が約1μmとなり、製造において高価な露光装置等の製造装置を必要とするためコスト高になるという欠点があった。

【0006】そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その第1の目的は、共振子および共振子型フィルタ等の弾性表面波装置において、その性能をできるだけ損なわずにさらに小型化をはかることである。また第2の目的は、共振子と同一の4分の1波長幅の電極指を用いることで、高価な露光装置等の製造装置を必要とせず、従来と同一水準の性能を有するトランスバーサル型やIDT型のフィルタを低コストで市場に提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

(1) 本発明の弾性波表面装置は、圧電体平板上に、弾性表面波の位相伝搬方向に直交して正と負の極性の金属導体を交互に平行配置してなるすだれ状電極を形成し共振子として使用する弾性表面波装置において、前記すだれ状電極の電極指の導体幅は、利用する弾性表面波の波長入のほぼ4分の1となし、前記すだれ状電極は、少なくとも3つ以上の領域に区分されて、かつ中央付近の前記電極指周期長PTcが両側の領域の前記電極指周期長PTsに対して異なる値を有することを特徴とする。【0008】(2) 前記(1)において、前記圧電体基板とすだれ状電極による弾性表面波の伝搬に係わる分散関係を代表する係数aが負の場合に於いては、PTc<PTsの条件を満たす周波数上昇型とし、前記係数aが正の場合には、PTc>PTsの条件を満たす周波数

【0009】(3) 前記(1)において、すだれ状電極はM対の正負電極指を持ち、電極指の交差幅が中央で1の値を取るWF(X)=COS(KX)の重み付けを有しており、かつKの値を0.5< ϵ <0.9として、 $K=\pi/(\epsilon M)$ で与えたことを特徴とする。

4

【0011】(5) 前記(2)において、前記PTsと前記PTcの比PTs/PTcを1以上から、ほぼ前記すだれ状電極を反射器と見なした場合の反射中心周波数 f_{R0} とアドミタンスの最大値 f_{T0} の周波数の比 f_{R0} / f_{T0} の範囲としたことを特徴とする。

【0012】(6) 前記(2)において、前記PTc と前記PTsの比PTc/PTsを1以上から、ほぼ前記すだれ状電極を反射器と見なした場合の反射中心周波数 f_{R0} とアドミタンスの最大値の周波数 f_{T0} の比 f_{R0} の範囲としたことを特徴とする。

【0013】(7) 前記(1)において、圧電体平板が128° YカットX伝搬であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を0.5から2%の範囲とし、PTs/PTcを1から1.02としたことを特徴とする。

【0014】(8) 前記(1)において、圧電体平板が128° YカットX伝搬であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長λとの比H/λを4から6%の範囲とし、PTc/PTs=1.008から1.02、かつきの値を0.6から0.85としたことを特徴とする。

【0015】(9) 前記(1)において、圧電体平板が128° YカットX伝搬であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を3から3.5%の範囲とし、前記PTcと前記PTsをほぼ等しく設定してフィルタ機能用途としたことを特徴とする。

【0016】(10) 前記(8)において、すだれ状電極の電極指の対数Mが50から250対としたことを特徴とする。

0 【0017】(11) 前記(1)において、圧電体基板が水晶であり、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を2から5%の範囲とし、PTs/PTcを1.007から1.02としたことを特徴とする。

【0018】(12) 前記(11)において、すだれ 状電極の電極指の対数Mを100から300対としたこ とを特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図1 から順を追って説明する。

【0020】(実施例1)図1は本発明の弾性表面波装置に使用される電極パターンを平面図で表した一実施の形態である。図1中の各部位の名称は、100は圧電体平板、101は正極性の給電導体、102は負極性の給電導体、103と104等はIDTの電極指、各々の給電導体101と102に接続する105と106は外部導通のためのパッド、107、108、109および110等はIDT電極指交差幅W(X)を作る分割線、11は、112のX軸に直交する方向であるY軸であ

50 り、112は弾性表面波の位相伝搬方向を示すX軸であ

_

る。100の圧電体平板は、水晶、タンタル酸リチウ ム、ニオブ酸リチウム等の圧電性を有する単結晶の表面 を鏡面研磨したもの、さらにZnO等の圧電性薄膜を形 成した基板等からなる。前記の100上に形成された1 DT等の導体パターンは、アルミニウムおよび金等の導 電性を有する金属膜を蒸着、スパッタ等の手段により薄 膜形成した後、フォトリソグラフィ技術によりパターン 形成して作られる。前記IDTは、正極性の給電導体1 01と負極性の給電導体102、これらに接続する正極 性の電極指103と負極性の電極指104等から構成さ れるが、その電極指群は利用する弾性表面波(レーリー 波またはリーキー波等)の位相進行方向(長手方向X 軸)に対して直交して、平行かつ周期的に多数配置され る。前記IDTの分割線107と110によって、正極 性と負極性の電極指の交差幅をゼロとなしている。ま た、108と109のIDT分割線は、正極と負極の電 極指の交差する幅寸法であるW(X)がCOS(KX) の重み付けを有している。さらにまた、前記IDTを構 成する電極指周期長PT(X)は、後述する図2におい て、特定の規則によりX座標位置により階段的な変化を 20 与えてある。

【0021】(実施例2)次に図2は、本発明の他の実施例を用いて、前述の図1における電極指周期長PT(X)の具体的設定例を示したものである。図中の各部位の名称は、200は圧電体平板、201の点線で囲まれた範囲は、IDT型SAW共振子、202と209は外部接続のためのパッドである。203と204の破線で囲まれる領域は電極指交差幅がゼロの領域であり、214の破線で示される領域は、一様な電極指交差幅を有する領域である。205と206等は電極指、207と208等は給電導体である。212の階段状関数FP(X)は、前記IDTの電極指長を決定する周波数ポテンシャル関数と名付けてよいものであり、213の曲線V(X)は、図2の実施例で得られる振動変位関数である。

【0022】前記212の周波数ポテンシャル関数FP(X)は、圧電体平板200の種類と材質により決定される。図2の例の場合は、水晶STカット-X伝搬基板のような場合での設定であり、電極指の周期長PT(X)はX軸の中央程短く階段状に設定されている。前

(X)はX軸の中央程短く階段状に設定されている。前 記のPT(X)は、Vs をアルミニウム膜がない場合の 弾性表面波の速度として、次式(1)にて設定される。

[0023]

【数1】

 $(1+FP(X)) f_{R0}=V_S/(2\cdot PT(X))$ (1)

【0024】式(1)中の基準となる周波数 f R o は、前記PT(X)=PTo(一定)とした場合に生じる図2形状のIDT型SAW共振子において、正負電極パッド202と209間を短絡して生じる、電極指導体群が作る反射特性の中心周波数である。

【0025】前記のFP(X)は周波数変化率の次元を有する。

【0026】また、図2中の周波数変化率で表した&i (i=0~3)は、式fi=Vs/(2・PTi (X))で与えられる周波数を用いて、

[0027]

【数2】

$$\xi_{i} = (f - f_{R0}) / f_{R0}$$

【0028】で与えられる。ことにくのは、アルミニウム膜の無い場合の周波数foに対応し、fo=Vs/(2・PTo)で与えられる。図2のFP(X)により得られる振動変位V(X)は、ほぼIDT型共振子の中央で最大となる余弦関数(COS(KX))状の変位を有し、X軸方向に関して、いわゆる振動エネルギ閉じ込め現象が実現している。この現象が発生する理由を、次の図3を用いて説明する。

【0029】図3において、300と301は給電導 体、305と306等はIDTの電極指、302の線で 囲まれた領域は第1の電極指の周期長PT1 (=Ln-1+S n-1)を有する I D T領域、同様に303は第2の電極指 の周期長PT2 (=Ln+Sn) を有するIDT領域、30 4は第3の電極指の周期長PT3 (=Ln+1+Sn+1)を 有するIDT領域である。また、図中に記載された ω1, ω2, ω3 は、対応する領域のIDTが有する アドミタンス特性のほぼ最大点の角周波数 $(\omega_0 = 2\pi)$ fro)、あるいはブラッグ周波数と言われるものであ る。また枠で囲まれた中の図は、前記各IDTがもつ波 数分散曲線を記述したものであり、この特性は縦軸を角 周波数ω=2πf軸、横軸を弾性表面波の振動振幅V (X)の作る波数Kとして図示したものである。また、 図3の左半面はKの虚数部を右半面はKの実数部を表し ている。307の波数分散曲線はIDT領域302のも のであり、308は304のIDT領域のものである。 前記の分散曲線は、おおむね次式(3)で近似できる。 [0030]

【数3】

$$\omega/\omega_0=1+a\gamma^2$$

40 【0031】ここで、ωοは前記のブラッグ周波数、αは係数、γは前記Κを弾性表面波の波長入で与えられる波数ko(=2π/λ)規格化した規格化波数である(γ=K/ko)。 曲線307、308はaが負の場合である。係数aは基板の種類、方位、弾性表面波の種類により決定されることを付け加える。波数分散曲線が虚数値をとる状態の弾性表面波は、伝搬できずに反射され、反対に実数の波数をもつ弾性表面波は伝搬可能である。中央のIDT領域303において、ω2の角周波数を有する弾性表面波がX軸の両側に放射されるわけであるが、まずIDT302側に進行した弾性表面波の状

30

態は、分散曲線307のP2点の波数K2(実数)を有 するため伝搬できる。一方右側のIDT304の領域に 進行した弾性表面波は、分散曲線308のP1点の波数 K1 (虚数)をとるため、伝搬できずに反射される。従 って以上から言えることは、前記係数aが負で、かつⅠ DTの周波数設定状態が ω1 >ω2 >ω3 の関係に ある場合においては、弾性表面波はX軸の正方向には伝 搬できずに反射され、その振幅は減衰するということで ある。さらにこれを押し進めて、 $\omega_1 < \omega_2 > \omega_3$ の 関係を作れば、弾性表面波は、ω2の角周波数を有する 中央IDT領域に閉じ込められることになり、前述の図 2中の213 V(X)の振動変位が実現することにな る。前記 ω_1 , ω_2 , ω_3 は、 $\omega_1 = 2\pi f_{11}$, ω_2 $=2\pi f_{12}$, $\omega_3 = 2\pi f_{13}$ とおいて式(2)の関 係で順に、よ2. よ1. よ2 と対応させることができ る.

【0032】つぎに図4を用いて、図1と図2中の圧電 体平板の具体例として128°Y-XLiNbOs 基板の例 を用いて、本発明の弾性表面波装置の構成法を説明す る。図4のIDTは、電極指幅Lが4分の1波長(A/ 4)の長さで構成されている。

【0033】図4の横軸は、アルミニウム電極膜厚Hに 対する弾性表面波の波長入の比H/入であり、縦軸は周 波数変化率△f/fをppm単位で表示している。曲線 400は前記IDTのもつアドミタンス最大点の周波数 f_{10} を、アルミニウム膜が無い場合の周波数 $f_{0} = V$ s/(2·PTo)を基準値Oとして、周波数変化率で 表示している。曲線401は、前記IDTのもつ反射特 性の中心周波数 f Roの電極指膜厚比H/A 依存性を図 示している。402は、402と401の周波数差が、 401と400の周波数差に等しくなるようにとって描 いたもので、400と402で挟まれた領域が弾性表面 波の反射領域即ち、ストップバンドを表している。曲線 400と401は、ほぼH/λ=3. 2において交差し ており、この状態においては、前記ストップバンドが消 滅しており、弾性表面波は反射されずに伝搬する。従っ て、この膜厚比の条件においては、トランスバーサル型 とかIDT型とかの弾性表面波の反射をきらう素子であ るフィルタの構成が、電極指幅しがほぼ4分の1波長 (A/4)の長さで実現できる。 実効的にはH/Aが 3~3.5%程度の範囲で反射係数は十分小さく効果的 である。H/λが3.2以下の領域においては、fro <fro の状態にあり、この領域の弾性表面波は図中に 重ねて図示した分散曲線403と404の特性となり、 いわゆる前述の図2の例の通り、周波数上昇型閉じ込め 状態を示す。逆に、 H/λが3. 2以上の領域におい ては、fro>fro の状態にあり、この領域の弾性表 面波は図中に重ねて図示した分散曲線405と406の 特性となり、前述の図2の例とは逆特性の、いわゆる周 波数降下型閉じ込め状態を示す。まとめると、前述の図

2の実施例は、前記の周波数上昇型閉じ込めに対応して おり、 図4のH/入<3.2以下の領域に対応した構 成法である。 H/A>3.2の場合には、図2の51 からく3を負として設定すれば周波数降下型エネルギ閉 じ込め状態を構成できる。つぎに、このようにして得ら れる本発明の弾性表面装置の振動変位状態を図5で説明 する.

【0034】図5の横軸504は弾性表面波装置のX座 標、縦軸503は素子の振動エネルギE(X)(振動変 位振幅Uの2乗に比例)を表す。図中の曲線500から 502は条件別の振動エネルギ分布を示す関数である。 前記条件となるものは、前述の図2のIDT201を3 分割し、その中央のIDTの周波数上昇量P(周波数ポ テンシャル)を前記 | fro - fro | = nを単位とし て、500の場合はP=0n、501の場合は、P= 0.8η、502の場合は、P=1.2ηと設定した場 合である。同図からわかる通り、周波数上昇量0に対し てPがゼロでない場合には、振動エネルギの中心集中度 が増していることがわかる。

【0035】この現象をさらにわかり易く表したもの が、図2の弾性表面波装置である共振子のQ値を示す特 性図 (図6) である。周知の様に共振子のQ値は共振子 のエネルギ損失の程度を表し、Qが大きい程損失の少な い良い共振子である。図6の横軸は中央IDTの前記周 波数上昇量Pであり、縦軸はP=0の場合の共振子Q値 Q_0 を基準として表している。 $\eta = 8000$ ppmとし てP=1.27のときに、約4倍のQ値が得られている ことがわかる。Q値上昇効果が認められる前記Pの具体 的な値は、水晶STカットX伝搬方位の場合は、前記電 極指の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入 を2から5%の範囲とし、7000~20000ppm であつた(このとき中央の電極指周期長PTcと両サイ ドの電極指周期長PTsの比はPTs/PTc=1.0 07~1.02である).128°Y-XLiNbOs 基板 の場合には、前記電極指の膜厚Hに対する弾性表面波の 波長Aとの比H/Aを4から6%の範囲とし、8000 ~2000 Oppmであった (このとき中央の電極指周期 長PTcと両サイドの電極指周期長PTsの比はPTc **/PTs=1.008~1.02である)。さらに圧電** 体平板が128°YカットX伝搬であり、 前記電極指 40 の膜厚Hに対する弾性表面波の波長入との比H/入を 0.5から2%の範囲とし、PTs/PTc=1から 1.02としてもQ値向上が実現できる。前記IDTに 使用した正負電極指の対数は、128°Y-XLiNbO3 基板の場合には、50~250対、水晶STカットX伝 搬方位の場合は、100から300対の範囲である。 【0036】つぎに、本発明の弾性表面波装置に発生す る不要共振、即ちスプリアスについての抑圧手段を説明 する。一例として、前述の128°Y-XLiNbO3基板 50 の例をとり説明する。前記の基板において、電極膜厚比 H/入を0.05に設定して周波数降下型のエネルギ閉じ込め型共振子を構成すると、縦インハーモニックモードによるスプリアスは主共振モードであるSOモードの上側に発生する。図8にこの様子を示す。図中の点線で表示された804、805のモードがスプリアスである。802は前記主共振モード、803は反共振モードである。

【0038】従って128° Y-XLiNbO3 基板の場合には、 $\xi=0.5$ から0.9の範囲に対して、P=0から1.2の条件でのスプリアスが抑圧できる。他の基板方位に関しても、ほぼ同様な傾向を示した。

[0039]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、反射器を用いずIDTのみで共振子を構成し、前記IDTを複数に分割したうえに、各分割されたIDTの電極指周 30 期長を使用する圧電基板の性質が、周波数上昇型か周波数降下型かに対応して周波数ポテンシャルを共振子の振動エネルギが中央に集中して閉じ込められる様に設定することにより、従来になく小型で性能のすぐれたIDT

型共振子と、これを用いて横および縦多重モード型の共振子型フィルタが実現できるため、さらに小型化が要求されるPHS、GSM等の携帯型通信装置およびVCS O等の小型化に貢献できる。また、余弦関数COS(KX)のKを適正にして前記IDTの電極指重み付けを行うことにより、縦インハーモニックモード群からなるスプリアスを抑圧することが可能となり、フィルタ等に本発明の弾性表面波装置を用いた際に、前記スプリアスに妨害されずに優れた減衰特性を得ることができる。

10

【0040】さらにまた、128°Y-XLiNbQs 基板において、電極指の膜厚比H/入をほぼ0.032と設定することにより、電極指幅Lが4分の1波長でも弾性表面波の反射の起きない状態が実現できるために、高度な加工装置を使わなくても数百MHzのSAWフィルタが実現でき素子コストの低減が可能となり、今後多大の利益が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の弾性表面波装置の一実施例を示す平面図。

【図2】 本発明の他の実施例が示す図。

【図3】 本発明の弾性表面波装置の動作原理を解説する概念図。

【図4】 本発明の一実施例が示す圧電体平板の特性 図、

【図5】 本発明の図1と図2が有する特性図。

【図6】 本発明の図1と図2が有する特性図。

【図7】 本発明の図1が有する特性図。

【図8】 本発明の図1が示す他の特性図。

【符号の説明】

0 100 圧電体平板

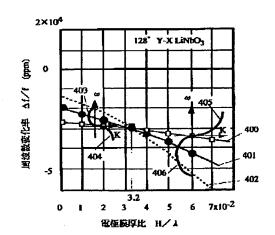
101 正極の給電導体

102 負極の給電導体

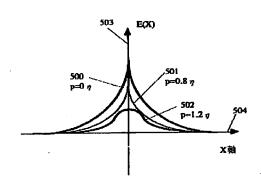
103 正極の電極指

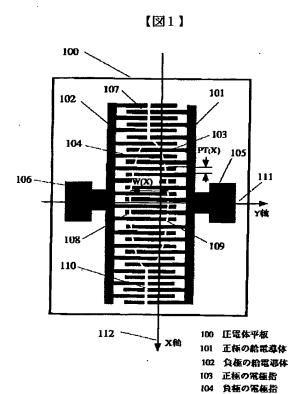
104 負極の電極指

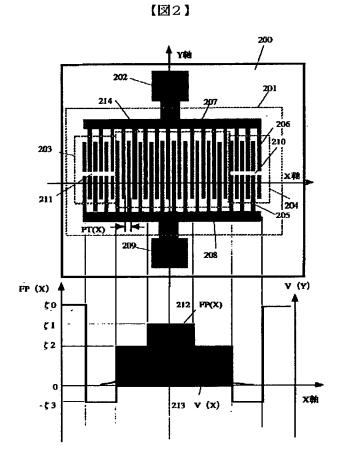
【図4】

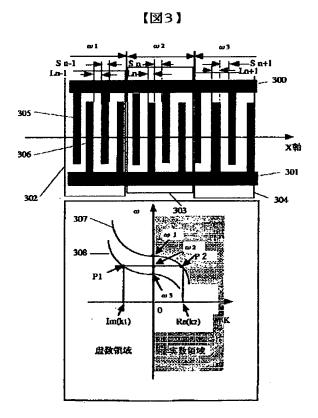


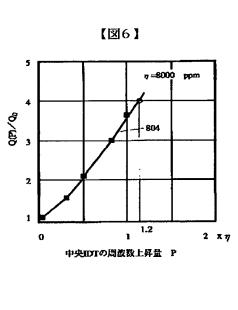
【図5】



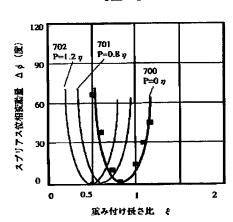








【図7】



【図8】

